

2024年度JVIA表彰報告

2024年度JVIA表彰の各賞が決定しましたのでご報告いたします。表彰式は2025年5月30日に、日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋)第一会議室で行われました。

JVIA表彰は、当工業会の会員企業の中で、優秀で他の模範とすべきものを審査により選定し、真空産業に携わり、その発展に貢献していると認められる個人又はチームを表彰するものです。



表彰式参加のみなさん

賞名	社名	受賞者	受賞テーマ
真空装置大賞	芝浦メカトロニクス株式会社	藤井 崇 久保田 翔大 松橋 亮	高生産性スパッタリング装置
真空コンポーネント大賞	株式会社アルバック	石樽 文昭 稲吉 さかえ 山本 良明 佐藤 洋志	腐食性ガスを用いる真空装置用表面処理「VACAL-Z」の開発
真空装置部門賞	株式会社コスモ・サイエンス	池田 善和 浅田 健一 河合 徹	有機EL 成膜装置
真空コンポーネント・部品・材料部門賞	アルバック機工株式会社	内村 誠 鈴木 規浩 山崎 真宏 宮田 悠平	分析装置向け 超静音で油漏れしない油回転真空ポンプ Gv135
イノベーション賞	株式会社大槻精機	萱山 邦彦 湯本 真也	総削り一体型真空チャンバ
技能・業務部門賞	住友重機械工業株式会社	谷津 貴裕	クライオポンプの性能測定方法に関するISO 規定の制定
	アルバック・クライオ株式会社	村山 吉信	
	キヤノンアネルバ株式会社	桑島 淳宏 岸 正史	

真空装置大賞

社 名：芝浦メカトロニクス株式会社

受 賞 者：藤井 崇、久保田 翔大、松橋 亮

受賞テーマ：高生産性スパッタリング装置

この度は、真空装置大賞を頂き、誠にありがとうございます。入社以来、一貫して真空に関わる仕事を担当しています。お客様のご要望から装置仕様、プロセス検討し、真空装置を製作しております。スパッタリング法での薄膜形成製品は世の中に数多く普及しており、装置に要求される性能も多種多様で、装置構成も同じものはないくらいです。装置納入後は、定期的にお客様を訪問し、開発状況や生産ラインでの使用状況をお聞きし、その中から、装置の改良点・改善点を見つけ出し、都度バージョンアップした装置を提案するようしています。今回受賞したテーマもお客様のご要望からユニット開発し、高生産性のスパッタリング装置をリリースすることができました。今後も各種部品が小型・高機能化していく中、薄膜形成製品は、ますます多くなり、真空プロセスに期待されるニーズも高度化していくことが予想されます。お客様が満足できる装置開発を進め、社会に貢献していきます。



藤井 崇 氏、久保田 翔大 氏、松橋 亮 氏

真空コンポーネント大賞

社 名：株式会社アルバック

受 賞 者：石樽 文昭、稲吉 さかえ、山本 良明、佐藤 洋志

受賞テーマ：腐食性ガスを用いる真空装置用表面処理「VACAL-Z」の開発

この度は、真空コンポーネント大賞という名誉ある賞を受賞し、大変光栄に存じます。本製品は、CVD やエッチング装置など腐食性ガスを使用する真空装置向けの表面処理「VACAL-Z」です。従来のポーラス型アノード酸化処理（アルマイト処理）は多く使用されていますが、高温部ではクラックの発生による耐食性の低下やパーティクルの増加が問題となっていました。本製品は、これらの問題を解決し、高耐食性と低ガス放出が期待できる表面処理となっています。また、大型真空装置部品にも表面処理が可能な技術の開発や、ランニングコストの低減に寄与する再生処理技術も開発し、お客様のニーズに応えることができる製品となりました。本製品の開発・評価に携わった多くの皆様には、心から感謝申し上げます。今後もお客様の要望にお応えできる商品開発に精進し、お客様にとって価値のある製品を生み出して参ります。



石樽 文昭 氏、稲吉 さかえ 氏、佐藤 洋志 氏

真空装置部門賞

社 名:株式会社コスモ・サイエンス
 受 賞 者:池田 善和、浅田 健一、河合 徹
 受賞テーマ:有機EL成膜装置

この度は、このような素晴らしい賞をいただきまして、誠にありがとうございます。試行錯誤を繰り返し開発した「有機EL成膜装置」が、このような形で評価されたことは、開発者一同にとって大きな喜びであります。

今回の受賞は、共に困難を乗り越えてきた開発チームの努力の結晶であり、ご指導いただいた皆様、そして温かく見守ってくださった関係者の皆様の支えがあってこそのもです。心より感謝申し上げます。

本装置は、有機材料の研究開発を目的としたデバイス作成という課題に対し、チャンパーの小型化による材料使用効率の向上や独自のマスク機構を用いることで、新たなソリューションを提供することを目指しました。少量・多品種という要望に対応する為に、様々な困難もありましたが、チーム一丸となって解決に取り組みました。

今回の受賞を励みに、この有機EL成膜装置が社会の発展に貢献できるよう、さらなる改善に向けて邁進してまいります。また、今回の経験を活かし、次世代の装置開発にも積極的に挑戦していきたいと考えております。



池田 善和 氏、浅田 健一 氏

真空コンポーネント・部品・材料部門賞

社 名:アルバック機工株式会社
 受 賞 者:内村 誠、鈴木 規浩、山崎 真宏、宮田 悠平
 受賞テーマ:分析装置向け 超静音で油漏れしない油回転真空ポンプ Gv135

今回、「真空コンポーネント・部品・材料部門」という大変名誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。合わせましてご尽力頂きました関係者の皆様、サプライヤの皆様にご感謝致します。アルバック機工の取組みが今回の受賞という形で認められたことは光栄であり、これからの製品開発の励みにもなります。

思考作業に影響を与えと言われる無意味な機械音、処理に時間を費やす油の漏れ、油の逆流による装置の故障に費やす時間や費用の発生は、お客様における生産性の向上への妨げとなります。

生産性の向上に寄与する真空ポンプを目指し、“超静音で油漏れしない”をコンセプトとした製品開発に取り組みました。

技術面や製造面などの課題解決に関係者のご支援をいただきながら、“油回転真空ポンプ Gv135”の製品化を実現することができました。

今後お客様における生産性の向上などの日々の活動に貢献することを念頭に製品開発に努めてまいります。



内村 誠 氏、鈴木 規浩 氏、
山崎 真宏 氏、宮田 悠平 氏

イノベーション賞

社 名:株式会社大楨精機
 受 賞 者:萱山 邦彦、湯本 真也
 受賞テーマ:総削り一体型真空チャンバ

このたびは日本真空工業会様よりイノベーション賞を賜り、誠に光栄に存じます。受賞対象となった真空チャンバは、従来は溶接やアッセンブリーで製造されていた複雑な構造を、弊社の同時5軸加工技術により一体削り出しで実現したものです。さらにICFフランジ部も高精度なマシニング加工によって加工し、リークゼロの高い気密性を達成いたしました。

本製品は、多くの加工メーカーが困難と判断し、製造を断念してきた経緯があります。しかし弊社は、金属加工の限界に挑戦する数多くのプロジェクトを通じて培ったノウハウを活かし、複雑な5軸プログラム設計と工具選定を重ね、CAM上でのシミュレーションと実加工を繰り返すことで、一体化での要求形状クリアと品質安定を可能にすることに成功しました。

この成果は、日頃よりご支援・ご指導をいただいている皆様のご尽力の賜物であり、心より感謝申し上げます。今後も挑戦を重ね、日本のものづくりに貢献してまいります。



湯本 真也 氏、萱山 邦彦 氏

技能・業務部門賞

社 名：住友重機械工業株式会社
アルバック・クライオ株式会社
キャノンアネルバ株式会社

受 賞 者：谷津 貴裕(住友重機械工業株式会社)
村山 吉信(アルバック・クライオ株式会社)
桑島 淳宏、岸 正史(キャノンアネルバ株式会社)

受 賞 テーマ：クライオポンプの性能測定方法に関するISO 規定の制定

この度、「クライオポンプの性能測定方法に関するISO 規定の制定」というテーマで技能・業務部門賞受賞の栄誉を賜りましたこと、大変光栄に存じます。

クライオポンプはこれまで国際規格が統一されておらず、2019年にISO 規格制定のプロジェクトが開始されました。

日本は単に技術的な標準化を行うだけではなく、先発メーカーとしての立場を踏まえ、これまでの業務方法に支障が出ないよう配慮しながら規格開発をするという難しい役割がありました。

規格内容にノウハウを極力含めないよう他国と調整をするなど、苦労は多々ありましたが、このISO 規格の制定によって、クライオポンプは勿論のこと、その主用途である半導体製造装置や半導体以外の用途においても国際規格に基づいた調達基準が運用されることになり、産業の活性化へ繋がると考えております。

また受賞を賜りました3社の他、真空工業会規格標準委員会の皆様のご協力のおかげで無事業務を遂行することができました。この場をお借りして、深くお礼申し上げます。



谷津 貴裕 氏、岸 正史 氏、
高橋 康司氏(村山 吉信 氏代理)